

立即发布

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 为领先的集成电路技术推出检测与检查系列产品

这些系统可提供解决成品率挑战的全面缺陷信息

【加州旧金山 2014 年 7 月 7 日讯】今天，在美国西部半导体设备暨材料展 (SEMICON West) 上，[KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）宣布推出四款新的系统——2920 系列、Puma™ 9850、Surfscan® SP5 和 eDR™-7110——为 16nm 及以下的集成电路研发与生产提供更先进的缺陷检测与检查能力。2920 系列宽波等离子图案晶圆缺陷检测系统、Puma 9850 激光扫描图案晶圆缺陷检测系统和 Surfscan SP5 无图案晶圆缺陷检测系统可提供更高的灵敏度和巨大的产能增益。这些检测仪让芯片制造商能够发现和监测对成品率至关重要的缺陷，从而支持芯片制造商在前沿领先设计节点对复杂结构、新型材料和新的工艺进行整合。这三款检测仪均可与 eDR-7110 电子束复查系统实现无缝连接，该系统利用更先进的自动缺陷分类功能迅速识别捕获的缺陷，为晶片制造厂商纠正措施提供精准资讯。

KLA-Tencor 晶圆检测集团执行副总裁 Bobby Bell 表示：“当我们的客户在 16nm、14nm 和更小设计节点整合众多独特技术时，他们面临着复杂的成品率与可靠性挑战。今天宣布推出的四款系统是我们检测与检查系列中的旗舰产品，融入了多种创新，有助于解决各种应用方面的缺陷率问题。我们的光学检测仪和电子束复查系统能够发现和识别关键纳米级缺陷，同时还能评估这些缺陷在同一晶圆、晶圆与晶圆之间和批次与批次之间的变化，从而实现更高产能。我们相信，通过提供全面缺陷信息，此系列产品能够帮助我们的客户表征和优化他们的先进工艺，以加快上市时间。”

采用第三代宽波等离子光源，2920 系列图案晶圆缺陷检测仪提供的亮度是其前身的两倍，令使用新型深紫外线 (DUV) 波段以及业界最小的光学检测像素成为可能。运用新的高级算法，这些新的光学模式将灵敏度提高到诸如 FinFET 等复杂集成电路设备结构上的细微凸出、微小桥接及其他图案缺陷。此外，2920 系列的新型 Accu-ray™ 与 Flex Aperture 技术能够迅速判断捕捉关键缺陷类型的最佳光学设置，显著缩短发现并解决工艺与设计问题的所需时间。

Puma 9850 激光扫描图案晶圆检测系统采用多个平台增强，能够提供适应各种产能的更高灵敏度，以支持各种各样的 FinFET 和先进的存储器设备检测应用。作为 2920 系列检测仪的补充，Puma 9850 的更高灵敏度操作模式更便于在显影后检测 (ADI)、光刻系统监控 (PCM) 和前端工序线工艺蚀刻层捕捉与成品率相关的缺陷。它拥有更高速度模式，能够以 Puma 9650 的两倍产能运行，并允许在薄膜与化学机械抛光 (CMP) 工艺模块中极具成本效益地监控制程偏移。

Surfscan SP5 无图案晶圆检测仪采用增强型 DUV 光学技术，能够以量产产能提供 20nm 以下的缺陷灵敏度，使检测细微基板或覆膜缺陷成为可能，以免这些缺陷干扰叠层集成电路的成功整合。与上一代的 Surfscan SP3 相比，Surfscan SP5 的处理速度快了三倍，不仅拥有高产能，而且还能检验和监控与多图案相关的更多工序及其他前沿领先的加工技术。

eDR-7110 电子束复查系统采用了一种新型 SEM 自动缺陷分类(S-ADC) 引擎，能够在生产期间精准地对缺陷进行分类，让工艺研发期间发现缺陷所需的时间显著缩短。此外，S-ADC 的结果还能在晶圆仍然位于 eDR-7110 上时自动触发额外的测试，例如元素成份分析或使用其他影像模式进行缺陷复查。这是 eDR-7110 特有的功能，它可以提高缺陷资讯的质量，有益于工程师改善工艺的判断。

世界各地的晶圆代工厂、逻辑电路与储存器制造商已经安装了多套 2920 系列、Puma 9850、Surfscan SP5 和 eDR-7110 系统，用于更先进技术节点的研发与产能提升。为了保持高性能和高产能，满足集成电路的生产需要，所有四款系统均由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持。关于更多信息，请参阅[检测与检查系列产品网页](#)。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与计量技术。这些技术为半导体、发光二极管 (LED) 及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，超过三十五年以来一直致力于为客户打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州米尔皮塔斯 (Milpitas)，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性声明:

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 2920 系列、Puma 9850、Surfscan SP5 和 eDR-7110 系统的预期性能，2920 系列、Puma 9850、Surfscan SP5 和 eDR-7110 系统相对于未来技术节点的可扩展性，半导体产业的趋势及其带来的预期挑战，KLA-Tencor 的客户对 2920 系列、Puma 9850、Surfscan SP5 和 eDR-7110 系统的预期使用，以及 2920 系列、Puma 9850、Surfscan SP5 和 eDR-7110 系统使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###